

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 6 部門第 2 区分

【発行日】令和 1 年 7 月 25 日 (2019.7.25)

【公表番号】特表 2017-506770 (P2017-506770A)

【公表日】平成 29 年 3 月 9 日 (2017.3.9)

【年通号数】公開・登録公報 2017-010

【出願番号】特願 2016-567142 (P2016-567142)

【国際特許分類】

G 0 2 B 26/06 (2006.01)

【 F I 】

G 0 2 B 26/06

【誤訳訂正書】

【提出日】令和 1 年 6 月 19 日 (2019.6.19)

【誤訳訂正 1】

【訂正対象書類名】特許請求の範囲

【訂正対象項目名】全文

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

各反射光学素子 (1 0 2 , 1 0 4) が光放射 (1 0 8) を複数回反射するように、マルチパスキャビティ (1 0 6) を規定する少なくとも 2 つの前記反射光学素子 (1 0 2 , 1 0 4) を備えた、前記光放射 (1 0 8) を処理するための装置 (1 0 0 ; 2 0 0) において、

前記装置が、補正素子と呼ばれる少なくとも 1 つの素子を備え、前記少なくとも 1 つの補正素子が複数の補正位置 (1 1 6) を提示し、前記少なくとも 1 つの補正素子の各々が、前記光放射の反射または透過を生成し、不均一な表面を有し、それによって前記補正位置 (1 1 6) の空間位相プロファイルは、前記補正位置 (1 1 6) のいくつかの異なる反射 / 透過地点について異なる位相シフトを有し、そして、前記補正位置 (1 1 6) のうちの少なくとも 2 つが異なる位相プロファイルを有し、

前記補正素子が：

前記マルチパスキャビティを規定する前記反射光学素子の 1 つ、および / または、

前記マルチパスキャビティに配置され、前記マルチパスキャビティを規定する前記反射光学素子と異なる補正素子

を備え、

ここで、前記装置 (1 0 0 ; 2 0 0) が、

- 前記光放射 (1 0 8) を異なる反射位置で少なくとも 4 回反射させるために各反射光学素子 (1 0 2 , 1 0 4) が配置されることを目的として、前記光放射 (1 0 8) を 2 つの反射光学素子 (1 0 2 , 1 0 4) との間で複数回行ったり来たりするようにマルチパスキャビティ (1 0 6) が配置されており、

- 前記反射光学素子の一方 (1 0 2) が、湾曲した反射面 (1 1 4) を備え、

前記マルチパスキャビティを規定する前記少なくとも 1 つの反射素子 (1 0 4) が、スルーホールを備え、前記スルーホールにより、処理される前記放射を前記マルチパスキャビティに導入し、及び / または処理後に前記マルチパスキャビティから出力することを可能にする

ことを特徴とする、装置。

【請求項 2】

前記少なくとも 1 つの補正光学素子が、前記マルチパスキャビティを規定する前記反射

光学素子の 1 つであることを特徴とする、請求項 1 に記載の装置 (1 0 0 ; 2 0 0)。

【請求項 3】

前記装置が、前記マルチパスキャビティを規定する前記反射光学素子にそれぞれ対応する少なくとも 2 つの補正素子を備えていることを特徴とする、請求項 1 または 2 に記載の装置。

【請求項 4】

前記少なくとも 1 つの補正素子が、前記マルチパスキャビティ内に配置され、前記マルチパスキャビティを規定する前記反射光学素子と異なることを特徴とする、請求項 1 から 3 のいずれか一項に記載の装置。

【請求項 5】

前記補正位置のうちの少なくとも 2 つが同じ位相プロファイルを有することを特徴とする、請求項 1 から 4 のいずれか一項に記載の装置。

【請求項 6】

前記少なくとも 1 つの補正光学素子 (1 0 2) が、少なくとも 1 つの補正位置 (1 1 6) のレベルで、少なくとも 1 つの位相板を備えていることを特徴とする、請求項 1 から 5 のいずれか一項に記載の装置 (1 0 0 ; 2 0 0)。

【請求項 7】

前記少なくとも 1 つの補正素子 (1 0 2) が、少なくとも 2 つの補正位置 (1 1 6) について少なくとも 2 つの空間位相プロファイルを有する単一の位相板を備えていることを特徴とする、請求項 1 から 6 のいずれか一項に記載の装置。

【請求項 8】

前記マルチパスキャビティ (1 0 6) を規定する前記反射光学素子 (1 0 2 , 1 0 4) が、互いに直交する 2 つの方向 (2 0 2 , 2 0 4) に配置され、前記装置 (2 0 0) はまた、前記反射光学素子 (1 0 2 , 1 0 4) のそれぞれの前記方向 (2 0 2 , 2 0 4) に対して 45° の角度で前記反射光学素子 (1 0 2 , 1 0 4) に対向して配置されているミラー (2 0 6) を備えていることを特徴とする、請求項 1 から 7 のいずれか一項に記載の装置 (2 0 0)。

【請求項 9】

前記マルチパスキャビティを規定する前記少なくとも 1 つの反射素子 (1 0 4) が、スルーホールを備え、前記スルーホールによって、処理すべき前記光放射を前記マルチパスキャビティに導入することを可能にするか、及び / 又は、処理後に前記マルチパスキャビティから出力することを可能にすることを特徴とする、請求項 1 に記載の装置 (2 0 0)。

【請求項 10】

前記反射光学素子の他方 (1 0 2) が平坦な反射面 (1 1 2) を備える、請求項 1 に記載の装置 (2 0 0)。

【請求項 11】

伝播の連続により光放射 (1 0 8) を処理するためのシステムであって、前記システムが、

請求項 1 から 9 のいずれか一項に記載の補正装置 (1 0 0 , 2 0 0)、
前記光放射 (1 0 8) を前記補正装置内に導入するための手段、および、
前記補正装置の出口で前記光放射 (1 0 8) を収集するための手段
を備えている、システム。